## МОРФОЛОГИЯ II СМАЧИВАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ. ФОРМИРУЕМОГО МЕТОДОМ ВАКУУМНОГО ОСАЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНА НА СТЕКЛЯННУЮ ПОДЛОЖКУ

О.Г. Бобрович 1), С.М. Барайшук 2)

- 1) Белорусский гсодарственный технологический университет, Минск, Беларусь
- 2)Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск, Беларусь e-mail:oiegbobrovich@yandex.ru

В работе приведены результаты изучения поверхностного слоя, использу- смого в качестве тыльного проводящего контакта тонкопленочного солнечного элемента, на стеклянной подложке. Для формирования слоя использовали импульсный ионный источник вакуумной электрелуговой плазмы при ускоряющем напряжении  $U=10~{\rm kB}$  для ассистирующих осаждение ионов Mo+ и интегральных потоках 1.2-1016- 1,1-1017 Mo+/ см2, а также при отсутствии ускоряющего напряжения ( $U=0~{\rm kB}$ ) и времени модифицирования 3, 6, 9 ч.

Морфология поверхности исходных и модифицированных образов изучалась, **используя** атсмно-**силовую** микроскопию в контактном режиме (атомно-силовой микроскоп NT-206, зонды CSC21), а смачивание дистиллированной водой определяли по равновесному краевому углу 0 смачивания (РКУС).

Формирование поверхностного слоя при  $U=\kappa B$  приводит к уменьшению значения средней шероховатости ( $R^\circ=1,0$  нм) поверхности в сравнении с шероховатостью (R=2,2 нм) исходной стеклянной подложки. Значение РКУС изменяется от  $0=35,5^\circ$  (t=3 ч) до  $0=61,7^\circ$  (t=9 ч), что существенно превышает РКУС поверхности исходного стекла ( $0=18,9^\circ$ ). Увеличение потока ионов при U=10 кВ приводит к изменению  $R^\circ$  и к уменьшению гидрофильности поверхности, но в большей степени, чем в при U=0 кВ. Достижение потока ионов величины 1,11017 Мо+/ см2, приводит к тому, что поверхность становится гидрофобной и РКУС увеличивается до значения  $0=93,9^\circ$ .